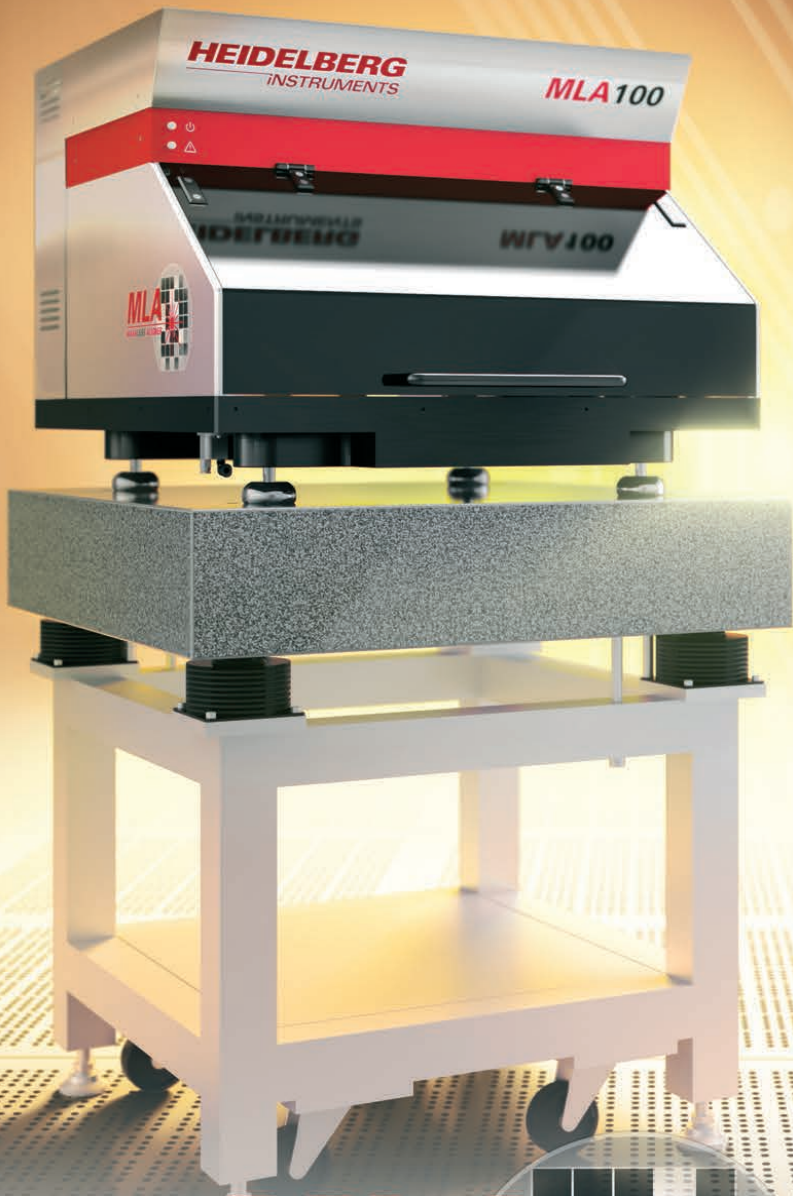


MLA100

HEIDELBERG
iNSTRUMENTS



MEMS



センサー



グレイスケール



エレクトロニクス

MLA
MASKLESS ALIGNER



GO MASKLESS
ACHIEVE MORE



STEP1: セットアップ

- ・デザイン制作用のCADソフトウェア付属
- ・対話式ユーザーインターフェイス
- ・業界標準のデータ形式対応 (dxf, gdsii, cif, gerber)

MLA100

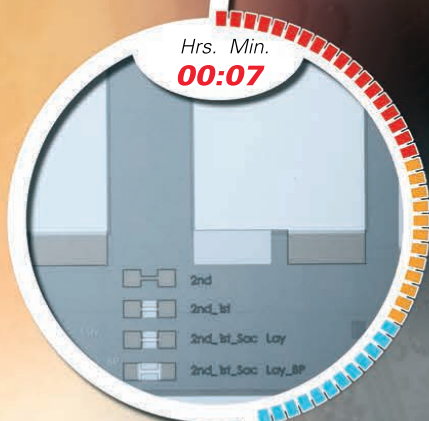


MORE INFO? SCAN THIS!



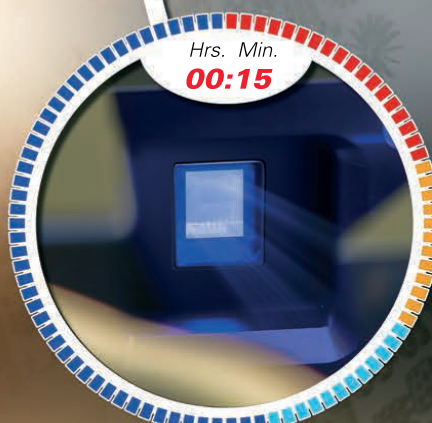
STEP2: ローディング

- ・シンプルなローディング手順
- ・1枚のチャックで、5×5mm²サイズから最大100×100mm²サイズまで対応
- ・基板サイズの自動認識
- ・エッジの気泡除去やウェッジ補正は不要



STEP3: アライメント

- ・高精度トップサイド・アライメント
- ・アライメント処理の短縮化
- ・厚膜レジストや極小基盤のアライメントも簡単
- ・アライメント精度 $\leq 1\mu\text{m}$



STEP4: 描画

- ・最小描画サイズ1 μm
- ・20×20mm²の描画時間は8分
- ・非接触描画
- ・厚膜レジストで、高アスペクト比の描画可能
- ・ベーシックグレイスケール描画モード搭載
- ・g線, h線, i線レジストにも対応

GO MASKLESS _____
ACHIEVE MORE

仕様は個々の処理条件によるものであり、装置のオプションによっても異なります。デザインと仕様は事前の告知なしに変更されることがございます。

